智慧財產及商業法院行政判決

115年度行專訴字第12號

民國115年8月19日辯論終結

原　　告　志聖工業股份有限公司

代　表　人　梁茂生

訴訟代理人　劉勝元律師

　　陳志銘專利師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　黃志偉

參　加　人　潘巧智

訴訟代理人　呂紹凡律師

　　洪珮瑜專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國114年12月11日經法字第11417307530號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

原告於民國107年11月7日以「晶圓貼膜機、拉膜裝置及晶圓貼膜方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共13項（嗣修正為12項），經被告編為第107139430號審查，准予專利，並發給發明第I737941號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定提起舉發。案經被告審查，以114年7月18日（114）智專議㈢05123字第11420755000號專利舉發審定書為「請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於114年12月11日以經法字第11417307530號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁

回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第357至358頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、證據1、2本身即屬證據3所欲改良之先前技術，證據3透過改變製程順序及結構配置，以迴避證據1、2既有貼附區導向設計所衍生之問題，本領域具通常知識者自無動機再回頭結合證據1、2之貼附區結構，原處分所為證據1、2與證據3結合實已違背證據3之技術教示方向，顯屬事後拼湊，若認證據1與證據3或證據2與證據3可結合，顯然忽略在製程方向與技術目的上的矛盾，並違反反向教示原則。

二、系爭專利請求項1明確記載夾持機構可沿夾持方向相對拉膜機構移動以夾持薄膜，證據3未揭露系爭專利請求項1技術特徵1D（要件編號之技術特徵參要件編號附表），證據3僅揭露夾具311於單一方向上的拉撐行為，亦未揭露請求項1分別在彼此正交的兩個方向拉動及夾持薄膜之技術特徵1E。證據3亦未揭露系爭專利請求項5全部技術特徵，或系爭專利請求項8之8D技術特徵。

三、證據1至證據3均未揭露系爭專利請求項1技術特徵1D，亦未揭露任何修改或變化成該技術特徵之技術教示或設計動機，又證據3的乾膜平整裝置作動時機為換料過程，而非貼膜當下，本領域具通常知識者不會在證據1或證據2的貼膜工作區設置此裝置，被告所稱「拉膜裝置設置於貼附區，是本領域具通常知識者基於證據1、3或證據2、3所能輕易完成」為後見之明。此外，將拉膜裝置設置在進行薄膜壓合定位之貼膜工作區中，會需要考量拉膜裝置與貼膜機構間的空間干涉、拉膜張力與貼膜壓力之協調，及拉膜時序與貼膜時序之同步控制等額外設計問題，此涉及複數技術層面之統合解決，並非單純之位置變更。

四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

參、被告答辯及聲明：

一、證據1、2雖與證據3在貼膜及裁切之執行程序（順序相反）不同，且證據2為證據3欲改良之先前技術，但證據1至證據3均設置有膜裁切區，且證據3所欲解決之問題（裁切後薄膜無法保持平整）、解決問題之技術手段（使用乾膜平整裝置）與貼膜及裁切之執行程序無關，即證據3並未明確記載或實質隱含乾膜平整裝置無法設置於證據1、2先貼膜後裁切之執行程序。縱使證據1、2與證據3在貼膜及裁切之執行程序不同，因三者均設置膜裁切區，故證據1至3在膜裁切區之作用、功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者當具有合理動機結合證據1、3或2、3，並將證據3裁切區之乾膜平整裝置3設置於證據1、2之裁切區。原告主張原處分忽略在製程方向與技術目的上的矛盾，並違反反向教示原則云云，並不可採。

二、原處分第7至8頁已比對證據3與系爭專利請求項1拉膜裝置，並說明證據3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵1D、1E，證據3未揭露系爭專利請求項1「一拉膜裝置，設置於該貼膜工作區」之技術特徵，故原告主張原處分認為技術特徵1D被揭露之意見明顯有漏未審酌或誤審之問題云云，並不可採。

三、證據3第2、3圖已明確揭露夾具311與虛線繪製之長方體結合，且虛線繪製之拉繩穿過虛線繪製之長方體；再比對第2、3圖夾具311位置，明顯可見夾具311已經移動一距離（即向外拉撐），且移動方向（虛線繪製之小箭頭）與桿體31移動方向（虛線繪製之大箭頭）正交，且夾具311係上、下夾持薄膜，該夾持方向實質上正交於拉膜方向（大箭頭方向），原告主張原處分認為技術特徵1E被揭露之意見明顯有漏未審酌或誤審之問題云云，並不可採。

四、原處分第10至11頁已比對證據3與系爭專利請求項5拉膜裝置，並說明證據3已揭露系爭專利請求項5全部技術特徵，系爭專利請求項5技術特徵5A、5C已被證據3揭露，原告主張原處分認技術特徵5A、5C被揭露之意見明顯有漏未審酌或誤審問題云云，並不可採。

五、原處分第13至14頁已比對證據3與系爭專利請求項8晶圓貼膜方法，並說明證據3已揭露系爭專利請求項8技術特徵8D，原告主張原處分認技術特徵8D被揭露之意見明顯有漏未審酌或誤審之問題云云，並不可採。

六、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：

一、證據1、證據2與證據3同屬晶圓貼膜領域，三者於膜輸送、膜裁切之作用與功效具有共通性，又證據1或證據2已揭露膜輸送、貼膜與裁切工作區；證據3已揭露夾持、拉撐、方向關係與吸附機構，晶圓貼膜裁切設備與乾膜平整裝置，屬相同問題、相近技術而具可預期效果，證據1、證據3或證據2、證據3之組合足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性。

二、證據3就系爭專利請求項5拉膜裝置已完整揭露，亦已揭露請求項5之附屬項即請求項6的雙機構及相反拉膜方向；請求項7的吸附機構，證據3足以證明系爭專利請求項5至7不具新穎性。

三、證據1、證據2揭露薄膜貼附晶圓；證據1至3揭露形成對應貼附區的鏤空洞；證據3揭露於洞邊至下一貼附區間夾持拉撐等技術內容，而裁切後形成鏤空洞，並在鏤空洞與下一貼附區間拉膜之技術特徵，證據3已提供教示，證據1、證據3或證據2、證據3之組合足以證明系爭專利請求項8至12不具進步性。

四、證據1、2與證據3均屬薄膜貼附、裁切及輸送相關技術，於技術領域及功能作用上具有關聯性；證據1至3皆設有膜裁切區，均存在有「裁切厚薄膜無法保持平整」的技術問題，證據3教示以「乾膜平整裝置」（邊切邊向外拉緊）來使薄膜保持平整，雖為「獨立裁切」之設計思路，但此技術手段與貼膜的執行順序無關，本即可整合設置於證據1或證據2之片材貼附裝置或貼膜裁切機中，不存在原告所稱之「反向教示」。系爭專利係將既有的貼膜裁切設備與既有的薄膜平整拉撐機構進行結合，在「裁切後薄膜產生縐摺、塌陷或張力

不均，影響後續貼膜或切割品質」之共同技術問題下，可預期的解決方案即「在貼膜與裁切工作區中加入證據3之膜夾持、拉撐、定位機構，以保持薄膜平整」。原處分及訴願決定並無違誤，應予維持。

五、聲明：駁回原告之訴。

伍、爭點（卷一第438頁）：

一、證據1（主引證）、證據3結合是否足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

二、證據2（主引證）、證據3結合是否足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

三、證據3是否足以證明系爭專利請求項5至7不具新穎性？

四、證據1（主引證）、證據3結合是否足以證明系爭專利請求項8至12不具進步性？

五、證據2（主引證）、證據3結合是否足以證明系爭專利請求項8至12不具進步性？

六、證據1（主引證）、證據2、證據3結合是否足以證明系爭專利請求項11不具進步性？

陸、本院判斷：

一、系爭專利係於107年11月7日提出申請，經實體審查於110年6月9日審定准予專利，是否有應撤銷專利權之情事，應以系爭專利核准審定時所適用之108年5月1日修正公布，同年11月1日施行之專利法(下稱核准時專利法)為斷。核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定：「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：□申請前已見於刊物者。……（第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。

二、系爭專利技術分析：

㈠系爭專利技術內容：一種晶圓貼膜機，包含膜輸送裝置、貼膜裝置以及拉膜裝置。膜輸送裝置包含二膜輸送輪。二膜輸送輪之間具有貼膜工作區，且膜輸送裝置用以使薄膜於貼膜

工作區沿輸送方向自其中一膜輸送輪移動至另一膜輸送輪。貼膜裝置設置於貼膜工作區，且貼膜裝置用以將薄膜貼附於晶圓。拉膜裝置設置於貼膜工作區。拉膜裝置可沿拉膜方向拉動薄膜，且拉膜方向實質上正交於該輸送方向（系爭專利摘要，卷一第39頁）。

㈡系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）

系爭專利公告之申請專利範圍共12項，其中第1、5、8項為獨立項，其餘為附屬項。其內容如下：

1.請求項1：一種晶圓貼膜機，包含：一膜輸送裝置，包含二膜輸送輪，該二膜輸送輪之間具有一貼膜工作區，且該膜輸送裝置用以使一薄膜於該貼膜工作區沿一輸送方向自其中一該膜輸送輪移動至另一該膜輸送輪；一貼膜裝置，設置於該貼膜工作區，且該貼膜裝置用以將該薄膜貼附於晶圓；以及一拉膜裝置，設置於該貼膜工作區，該拉膜裝置可沿一拉膜方向拉動該薄膜，且該拉膜方向實質上正交於該輸送方向；其中，該拉膜裝置包含一基座、一拉膜機構以及一夾持機構，該拉膜機構設置於該基座，該夾持機構設置於該拉膜機構，該夾持機構可沿一夾持方向相對該拉膜機構移動以夾持該薄膜，該拉膜機構可帶動該夾持機構沿該拉膜方向相對該基座移動，且該夾持方向實質上正交於該拉膜方向。

2.請求項2：如申請專利範圍第1項所述之晶圓貼膜機，其中該夾持方向與該拉膜方向皆實質上正交於該輸送方向。

3.請求項3：如申請專利範圍第1項所述之晶圓貼膜機，其中該拉膜裝置更包含用以吸附該薄膜的一吸附機構，且該拉膜機構與該夾持機構可相對該吸附機構移動。

4.請求項4：如申請專利範圍第1項所述之晶圓貼膜機，其中該夾持機構具有夾持該薄膜的一夾持狀態以及未夾持該薄膜的一釋放狀態，當該夾持機構於該夾持狀態時，該拉膜裝置相對該膜輸送裝置自該貼膜工作區中靠近其中一該膜輸送輪的一第一工作位置移動至靠近另一該膜輸送輪的一第二工作位

置，當該夾持機構於該釋放狀態時，該拉膜裝置自該第二工作位置歸位至該第一工作位置。

5. 請求項5：一種拉膜裝置，用以拉動適於貼附於晶圓的一薄膜，該拉膜裝置包含：一基座；至少一拉膜機構，設置於該基座；以及至少一夾持機構，設置於該至少一拉膜機構，該至少一夾持機構可沿一夾持方向相對該至少一拉膜機構移動以夾持該薄膜，該至少一拉膜機構可帶動該至少一夾持機構沿該拉膜方向相對該基座移動，且該夾持方向實質上正交於該拉膜方向。

6. 請求項6：如申請專利範圍第5項所述之拉膜裝置，其中該至少一拉膜機構以及該至少一夾持機構的數量皆為二，該二夾持機構之該夾持方向相同，且該二拉膜機構之該拉膜方向相反。

7. 請求項7：如申請專利範圍第5項所述之拉膜裝置，更包含用以吸附該薄膜的一吸附機構，且該拉膜機構與該夾持機構可相對該吸附機構移動。

8. 請求項8：一種晶圓貼膜方法，用以貼附一薄膜於晶圓上，該薄膜具有相鄰的一貼附區以及一下一個貼附區，該晶圓貼膜方法包含：執行一貼膜程序，將該貼附區貼附於一晶圓上；執行一裁切程序，裁切該薄膜的該貼附區而於該薄膜上形成一鏤空洞，該鏤空洞具有相對的一第一端以及一第二端，且該第二端較該第一端靠近該下一個貼附區；以及執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜。

9. 請求項9：如申請專利範圍第8項所述之晶圓貼膜方法，其中於執行該拉膜程序時，於該鏤空洞的該第二端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜。

10. 請求項10：如申請專利範圍第8項所述之晶圓貼膜方法，其中該薄膜之該鏤空洞更具有介於該第一端與該第二端之間的一中心位置，於執行該拉膜程序時，於該鏤空洞的該中心位置以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜。

11.請求項11：如申請專利範圍第8項所述之晶圓貼膜方法，更包含：執行一吸附程序，以吸附該薄膜。

12.請求項12：如申請專利範圍第11項所述之晶圓貼膜方法，其中於執行該吸附程序後執行該裁切程序以及該拉膜程序。

三、舉發證據說明：

㈠證據1為西元2010年4月8日日本第JP2010-80838A號「片材貼附裝置及貼附方法」專利案公開本（主要圖式如附件二所示）。

㈡證據2為西元2007年8月11日我國第M317071號「晶圓之貼膜裁切機」專利案公告本（主要圖式如附件三所示）。

㈢證據3為西元2014年1月21日我國第I424518號「晶圓壓膜機乾膜輸送機構」專利案公告本（主要圖式如附件四所示）。

㈣前揭證據公開或公告日均早於系爭專利申請日（西元2018年11月7日），可為系爭專利之先前技術。

四、爭點分析：

㈠證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性：

1.系爭專利請求項1：

⑴系爭專利請求項1與證據1比對：①證據1揭露一種片材貼附裝置，證據1圖式第1圖及說明書第[0014]段揭示該片材貼附裝置10，包含一拉出單元11、支撐作為被接著體的晶圓W的支撐單元12、將貼附用片材S1貼附於晶圓W的切斷按壓單元13、及捲取而回收的回收單元14。②證據1說明書第[0015]段揭示該拉出單元11，藉由馬達M使被拉出的原料片R賦予預定的張力。③證據1說明書第[0017]段揭示該切斷按壓單元13，在該位置進行原料片R的切斷與貼附用片材S1的貼附。④證據1說明書第[0019]段揭示該回收單元14，用以捲取回收不要的原料片部分R1。⑤證據1說明書第[0032]段揭示該原料片R不受限於感熱接著性接著片，亦可使用感熱接著性接著片如晶圓保護用的接著片。⑥證據1圖式第1至3圖揭示該拉出單元11與回收單元14間具有一貼膜工作區之技術特徵。

⑦證據1揭示一種片材貼附裝置，該原料片R可為晶圓保護用接著片之技術內容，相當系爭專利請求項1技術特徵1A。⑧證據1揭示片材貼附裝置包含一原料片R之拉出單元11及回收原料片R之回收單元14，該拉出單元11及回收單元14間包含一貼膜工作區之技術內容，相當系爭專利請求項1技術特徵1B。⑨證據1揭示該切斷按壓單元13處將原料片R的切斷與貼附用片材S1貼附之技術內容；證據1圖式第1至3圖揭示於該切斷按壓單元13處進行原料片之貼附作業之技術內容，相當系爭專利請求項1技術特徵1C。⑩證據1圖式第1圖及說明書第[0022]段揭示輥狀的原料片R的前導端拉出預定的長度並固定於捲取輥37，且驅動馬達M1、M2進行原料片R的拉出的同時，調整位於驅動輥21與回收用驅動輥35之間的原料片R的張力之技術內容。證據1以驅動馬達M1、M2調整原料片張力，與系爭專利請求項1設置於貼膜工作區之拉膜裝置有別，是以證據1未揭示系爭專利請求項1技術特徵1D、1E。

⑵系爭專利請求項1與證據3比對：①證據3圖式第1至3圖及說明書第7至8頁揭露晶圓壓膜機乾膜輸送機構，包括一基座1、一出料裝置2及一乾膜平整裝置3；其中該基座1上方係有一供乾膜延展以利進行切割作業之作業平台11；該乾膜平整裝置3係得以對乾膜進行夾持，以利出料裝置21進行捲動換料時得以同步隨乾膜做位移以保持乾膜平整度，該乾膜平整裝置3係為一兩端與導軌13活動設置並呈現跨置於乾膜上方之機動桿體31，另該機動桿體31於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之夾具311之技術內容。②證據3圖式第2、3圖揭示該兩端之夾具311拉膜方向、夾膜方向與導軌13輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容。③證據3之導軌13、機動桿體31及夾具311，相當系爭專利請求項1之拉膜裝置之基座、拉膜機構及夾持機構技術特徵。證據3乾膜平整裝置3與兩端導軌13活動設置，並跨置於乾膜上方之機動桿體31，該機動桿體31於兩端設有夾具311，相當系爭專利請求項1「該拉膜機構設置

於該基座，該夾持機構設置於該拉膜機構」之技術特徵。④證據3圖式第1至3圖揭示該夾具夾持方向、拉膜方向與乾膜前進方向互呈實質正交，相當系爭專利請求項1「該拉膜方向實質上正交於該輸送方向」及「該夾持方向實質上正交於該拉膜方向」之技術特徵。

⑶證據1與證據3均為應用於晶圓貼附膜料技術領域上具有關聯性；於捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用或功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者於面對膜料皺褶、捲曲良率問題，具有合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構之乾膜平整裝置技術特徵結合應用至證據1貼膜工作區上，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，且未產生無法預期之功效，故證據1（主引證）及證據3之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.系爭專利請求項2：

⑴系爭專利請求項2為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項2附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第2、3圖揭示該兩端之夾具311拉膜方向、夾膜方向與導軌13輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容。證據3已揭示系爭專利請求項2所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項2之發明，是以證據1（主引證）及證據3之結合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3.系爭專利請求項3：

⑴系爭專利請求項3為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項3附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展

於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置相當系爭專利請求項3之吸附機構技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項3所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項3之發明，是以證據1（主引證）及證據3之結合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4.系爭專利請求項4：

⑴系爭專利請求項4為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項4附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第5圖及說明書第7頁第4段至第8頁第1行揭示「當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項4所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項4之發明，是以證據1（主引證）及證據3之結合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

㈡證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性：

1.系爭專利請求項1：

⑴系爭專利請求項1與證據2比對：①證據2說明書第5頁[新型所屬之技術領域]揭示「本創作『晶圓之貼膜裁切機』，涉及一種應用於晶圓(wafer)後段製程，特別指一種將膠膜DAF(die attach film)擴張後裁切並黏貼至晶圓與框架背面之自動化機台」。②證據2圖式第8圖及說明書第9頁最後1段揭示「如第八圖所示，待切割之膠膜9係固定於進料單元2上，並經過兩滾輪41夾壓，再通過進料支架51，穿過上貼合裁切

機構5與下貼合裁切機構6之間，再經過出料支架52、兩滾輪41，最後由出料單元3將使用過後之殘餘膠膜9捲收」。③證據2揭示「晶圓之貼膜裁切機」相當系爭專利請求項1技術特徵1A。④證據2圖式第8圖揭示固定待切割之膠膜9於進料單元2、捲收使用過後之殘餘膠膜9於出料單元3，及膠膜9穿過上貼合裁切機構5與下貼合裁切機構6間之技術內容，相當系爭專利請求項1技術特徵1B。⑤證據2圖式第8圖揭示膠膜9穿過上貼合裁切機構5與下貼合裁切機構6，進行貼膜作業之技術內容，相當系爭專利請求項1技術特徵1C。⑥證據2未揭示系爭專利請求項1技術特徵1D、1E。

⑵系爭專利請求項1與證據3比對：①證據3圖式第1至3圖及說明書第7至8頁揭露晶圓壓膜機乾膜輸送機構包括一基座1、一出料裝置2及一乾膜平整裝置3；其中該基座1上方係有一供乾膜延展以利進行切割作業之作業平台11；該乾膜平整裝置3係得以對乾膜進行夾持，以利出料裝置21進行捲動換料時得以同步隨乾膜做位移以保持乾膜平整度，該乾膜平整裝置3係為一兩端與導軌13活動設置並呈現跨置於乾膜上方之機動桿體31，另該機動桿體31於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之夾具311之技術內容。②證據3圖式第2、3圖揭示該兩端之夾具311拉膜方向、夾膜方向與導軌13輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容。③證據3之導軌13、機動桿體31及夾具311，相當系爭專利請求項1之拉膜裝置之基座、拉膜機構及夾持機構技術特徵。證據3乾膜平整裝置3與兩端導軌活動設置，並跨置於乾膜上方之機動桿體31，該機動桿體31於兩端設有夾具，相當系爭專利請求項1「該拉膜機構設置於該基座，該夾持機構設置於該拉膜機構」之技術特徵。④證據3圖式第1至3圖揭示該夾具夾持方向、拉膜方向與乾膜前進方向互呈實質正交，相當系爭專利請求項1「該拉膜方向實質上正交於該輸送方向」及「該夾持方向實質上正交於該拉膜方向」之技術特徵。

⑶證據2與證據3均為應用於晶圓貼附膜料技術領域上具有關聯性；於捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用或功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者於面對膜料皺褶、捲曲良率問題，具有合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構之乾膜平整裝置技術特徵結合應用至證據2貼膜工作區上，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，且未產生無法預期之功效，故證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.系爭專利請求項2：

⑴系爭專利請求項2為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項2附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第2、3圖揭示該兩端之夾具311拉膜方向、夾膜方向與導軌13輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容。證據3已揭示系爭專利請求項2所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項2之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3.系爭專利請求項3：

⑴系爭專利請求項3為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項3附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置相當系爭專利請求項3之吸附機構技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項3所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合

可輕易完成系爭專利請求項3之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4.系爭專利請求項4：

⑴系爭專利請求項4為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項4附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第5圖及說明書第7頁第4段至第8頁第1行揭示「當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項4所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項4之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

㈢證據3足以證明系爭專利請求項5至7不具新穎性：

1.系爭專利請求項5：

⑴系爭專利請求項5與證據3比對：①證據3圖式第1至3圖及說明書第7至8頁揭露晶圓壓膜機乾膜輸送機構，包括一基座1、一出料裝置2及一乾膜平整裝置3；其中該基座1上方係有一供乾膜延展以利進行切割作業之作業平台11及供乾膜平整裝置3活動位移之導軌13；該乾膜平整裝置3係得以對乾膜進行夾持，以利出料裝置21進行捲動換料時得以同步隨乾膜做位移以保持乾膜平整度，該乾膜平整裝置3係為一兩端與導軌13活動設置並呈現跨置於乾膜上方之機動桿體31，另該機動桿體31於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之夾具311之技術內容。②證據3圖式第2、3圖揭示該兩端之夾具311拉膜方向、夾膜方向與導軌13輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容。

③證據3之導軌13、機動桿體31設於導軌13上及夾具311設於該機動桿體31上之特徵，與系爭專利請求項5之基座、拉膜機構及夾持機構相同；證據3圖式第3圖揭示該夾具311夾持乾膜之夾膜方向、機動桿體31兩端向外拉撐之拉膜方向；以及沿導軌13輸送乾膜之輸送方向(圖3虛線箭頭)互呈實質正交之技術內容，與系爭專利請求項5「該至少一夾持機構可沿一夾持方向相對該至少一拉膜機構移動以夾持該薄膜，該至少一拉膜機構可帶動該至少一夾持機構沿該拉膜方向相對該基座移動，且該夾持方向實質上正交於該拉膜方向」之技術內容相同。

⑵基上比對，系爭專利請求項5與證據3差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，證據3可以證明系爭專利請求項5不具新穎性。

2.系爭專利請求項6：

⑴系爭專利請求項6為直接依附於系爭專利請求項5的附屬項，包含請求項5全部技術特徵，如前所述，證據3足以證明系爭專利請求項5不具新穎性，系爭專利請求項6附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第1圖及說明書第7頁第3段揭示該機動桿體31於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之夾具311之技術內容。證據3已揭示系爭專利請求項6所附屬之技術特徵，差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，證據3可以證明系爭專利請求項6不具新穎性。

3.系爭專利請求項7：

⑴系爭專利請求項7為直接依附於系爭專利請求項5的附屬項，包含請求項5全部技術特徵，如前所述，證據3足以證明系爭專利請求項5不具新穎性，系爭專利請求項7附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展

於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置相當系爭專利請求項7之吸附機構技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項7所附屬之技術特徵，差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，證據3可以證明系爭專利請求項7不具新穎性。

㈣證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項8至12不具進步性：

1.系爭專利請求項8：

⑴系爭專利請求項8與證據1比對：①證據1圖式第1圖及說明書第[0014]段揭示一種片材貼附裝置，該片材貼附裝置10，包含一拉出單元11、支撐作為被接著體的晶圓W的支撐單元12、將貼附用片材S1貼附於晶圓W的切斷按壓單元13、及捲取而回收的回收單元14。②證據1說明書第[0017]段揭示該切斷按壓單元13，由具備按照晶圓W的大小於原料片R形成略圓形的切口的閉迴路狀的刀片27的環28，並在該位置進行原料片R的切斷與貼附用片材S1的貼附。③證據1圖式第1至3圖揭示該原料片R經裁切並貼附於晶圓W上；證據1第3圖揭示該原料片R經裁切後形成一具有第一端及二端之切口，該第二端較第一端靠近下一個貼附區之技術內容。④證據1揭示將貼附用片材S1貼附於晶圓W，相當系爭專利請求項8「一種晶圓貼膜方法，用以貼附一薄膜於晶圓上」；證據1之片材貼附裝置10，包含一拉出單元11、支撐作為被接著體的晶圓W的支撐單元12、將貼附用片材S1貼附於晶圓W的切斷按壓單元13、及捲取而回收的回收單元14；該切斷按壓單元13按照晶圓W的大小於原料片R形成略圓形的切口；及該切口具有第一端及二端之技術內容，相當系爭專利請求項8「該晶圓貼膜方法包含：執行一貼膜程序，將該貼附區貼附於一晶圓上；執行一裁切程序，裁切該薄膜的該貼附區而於該薄膜上形成一鏤空洞，該鏤空洞具有相對的一第一端以及一第二端，且該第二端較該第一端靠近該下一個貼附區」之技術特徵。⑤證據1未揭示系爭專利請求項8技術特徵8D。

⑵系爭專利請求項8與證據3比對：①證據3說明書第7頁第2段揭示「該出料滾筒21係做為捲捆未經切割之乾膜，該收料滾筒22係做為捲收經切割後之乾膜餘料」。②證據3第5圖及說明書第7頁最後1段至第8頁第1行揭示「當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」。③證據3已揭示系爭專利請求項8「執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜」之技術特徵。

⑶證據1與證據3均為應用於晶圓貼附膜料技術領域上具有關聯性；於捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者於面對膜料皺褶、捲曲良率問題，具有合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構切割後拉膜步驟之技術特徵結合應用至證據1晶圓貼膜方法上，而輕易完成系爭專利請求項8之發明，且未產生無法預期之功效，故證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

2.系爭專利請求項9：

⑴系爭專利請求項9為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項9附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第5圖及說明書第7頁最後一段至第8頁第1行揭示「當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」之技術內容。證據3乾膜切割後即形成系爭專利之鏤空洞，該機動桿體31即移動至作業平

台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，即相當系爭專利於該鏤空洞的該第二端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜。證據3已揭示系爭專利請求項9所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項9之發明，是以證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

3.系爭專利請求項10：

⑴系爭專利請求項10為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項10附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第1、5圖揭示該乾膜切割後形成之鏤空洞第一端與第二端間包含一中心位置，該機動桿體31移動至作業平台11一端並透過夾具311對下一個乾膜進行夾持、拉撐之技術內容。證據3已揭示系爭專利請求項10所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項10之發明，是以證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項10不具進步性。

4.系爭專利請求項11：

⑴系爭專利請求項11為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項11附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置吸附乾膜相當系爭專利請求項11之吸附程序之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項11所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項11之發明，是以

證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項11不具進步性。

5.系爭專利請求項12：

⑴系爭專利請求項12為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項12附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置吸附乾膜後進行切割及拉膜作業之技術特徵，相當系爭專利請求項12執行該吸附程序後執行該裁切程序以及該拉膜程序之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項12所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、3之組合可輕易完成系爭專利請求項12之發明，是以證據1（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性。

㈤證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項8至12不具進步性：

1.系爭專利請求項8：

⑴系爭專利請求項8與證據2比對：①證據2說明書第5頁[新型所屬之技術領域]揭示「本創作『晶圓之貼膜裁切機』，涉及一種應用於晶圓(wafer)後段製程，特別指一種將膠膜DAF(die attach film)擴張後裁切並黏貼至晶圓與框架背面之自動化機台」。②證據2圖式第8圖及說明書第9頁最後1段揭示「待切割之膠膜9係固定於進料單元2上，並經過兩滾輪41夾壓，再通過進料支架51，穿過上貼合裁切機構5與下貼合裁切機構6之間，再經過出料支架52、兩滾輪41，最後由出料單元3將使用過後之殘餘膠膜9捲收」。③證據2圖式第9、10圖及說明書第10頁第1段揭示「當下貼合裁切機構6與膠膜9都達到適當定位後，上貼合裁切機構5將會向下移動，首

先，令上外環體53將膠膜9向下壓，接著上外環體53將與下外環體63接合，以區隔出適當區域的膠膜9，緊跟著內環體54將再次的向下位移且同時在此下移過程完成膠膜的擴張，並與置料盤64貼合，以令膠膜9被黏貼於框架7與晶圓8頂面，值此同時，刀片環541將接續降低，以便將膠膜9沿著置料盤64外圍切斷」。④證據2待切割之膠膜經上貼合裁切機構5與下貼合裁切機構6後經出料單元3捲收殘餘膠膜9之技術內容，相當系爭專利請求項8之薄膜具有相鄰的一貼附區以及一下一個貼附區，及該貼附區形成一具有第一端以及一第二端之鏤空洞；證據2之上貼合裁切機構5及下貼合裁切機構6裁切並切斷膠膜9步驟，相當系爭專利請求項8貼膜程序及裁切程序，是以證據2已揭示系爭專利請求項8技術特徵8A、8B、8C。惟證據2未揭示系爭專利請求項8技術特徵8D。

⑵系爭專利請求項8與證據3比對已如前述，證據3已揭示系爭專利請求項8技術特徵8D。

⑶證據2與證據3均為應用於晶圓貼附膜料技術領域上具有關聯性；於捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者於面對膜料皺褶、捲曲良率問題，具有合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構切割後拉膜步驟之技術特徵結合應用至證據2晶圓之貼膜裁切機上，而輕易完成系爭專利請求項8之發明，且未產生無法預期之功效，故證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

2.系爭專利請求項9：

⑴系爭專利請求項9為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項9附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第5圖及說明書第7頁最後一段至第8頁第1行揭示「當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾

持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」之技術內容。證據3乾膜切割後即形成系爭專利之鏤空洞，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，即相當系爭專利於該鏤空洞的該第二端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜。證據3已揭示系爭專利請求項9所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項9之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

3.系爭專利請求項10：

⑴系爭專利請求項10為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項10附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3圖式第1、5圖揭示該乾膜切割後形成之鏤空洞第一端與第二端間包含一中心位置，該機動桿體31移動至作業平台11一端並透過夾具311對下一個乾膜進行夾持、拉撐之技術內容。證據3已揭示系爭專利請求項10所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項10之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項10不具進步性。

4.系爭專利請求項11：

⑴系爭專利請求項11為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項11附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置吸附乾膜相當系爭專利請

求項11之吸附程序之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項11所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項11之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項11不具進步性。

5.系爭專利請求項12：

⑴系爭專利請求項12為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項12附屬技術特徵亦如前述。

⑵證據3說明書第7頁第1段揭示「該作業平台11於一端係向上設置有一供吸膜裝置上下活動設置，以利吸膜裝置吸附延展於作業平台11的乾膜藉以穩定乾膜進行切割作業之移動裝置15」之技術內容。證據3吸膜裝置吸附乾膜後進行切割及拉膜作業之技術特徵，相當系爭專利請求項12執行該吸附程序後執行該裁切程序以及該拉膜程序之技術特徵。證據3已揭示系爭專利請求項12所附屬之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3之組合可輕易完成系爭專利請求項12之發明，是以證據2（主引證）、證據3結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性。

㈥證據1（主引證）、證據2、證據3結合足以證明系爭專利請求項11不具進步性：

1.系爭專利請求項11為直接依附於系爭專利請求項8的附屬項，包含請求項8全部技術特徵，如前所述，證據1、3之組合或證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，系爭專利請求項11附屬技術特徵亦如前述。

2.證據1、3之組合或證據2、3之組合可以證明系爭專利請求項11不具進步性已如前述，又證據1、證據2與證據3均為應用於晶圓貼附膜料技術領域上具有關聯性；於捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用或功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者於面對膜料皺褶、捲曲良率問題，所屬技術

領域中具有通常知識者具有合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構之乾膜平整裝置技術特徵應用至證據1或證據2貼膜工作區上，而輕易完成系爭專利請求項11之發明，且未產生無法預期之功效，故證據1（主引證）、證據2、證據3結合足以證明系爭專利請求項11不具進步性。

㈦原告主張不可採之理由：

1.原告主張證據1、3或證據2、3之結合有違反向教示原則，不具結合動機。證據1與證據2為「整合貼膜及裁切於同一設備」，證據3為「獨立裁切」，後續再進行貼附。證據1與證據2為證據3所欲改良之先前技術，證據3改變製程順序，迴避證據1、2貼附區導向設計所衍生問題，該領域具通常知識者無動機將具有解決新問題方案之證據3結合證據1、2之貼附區舊有方案，證據3構成對證據1、2否定與排斥的反向教示，證據3裝置無動機引入證據1、2之貼附區結構云云（卷一第20至21頁）。經查：

⑴所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術與系爭專利在所欲解決問題主觀上略有不同，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段（最高行政法院103年度判字第118號行政判決意旨參照）。

⑵證據1、2揭露之技術內容係「整合貼膜及裁切於同一設備」，證據3揭露之技術內容係「膜料單獨裁切」；其中證據2恰為證據3說明書中所載之先前技術，證據3說明書[先前技術]記載證據3可改善證據2再進行膠膜貼合晶圓前須先擴張撐開步驟較多，及避免切割接觸晶圓，裁切之膜料大於晶圓面積，不利晶圓外周緣布置線路等技術問題；證據3為一種應用於先切膜後預貼作業之乾膜輸送機構，其能有效穩定

乾膜於切割後續行捲動替換切割區段之穩定性，使其保持平坦以避免後續作業切割不良。另證據1發明目的為提供一種片材貼附裝置及貼附方法，其在切斷的構造簡易化的同時，藉由在同一處大致同時進行貼附用片材的形成與對被接著體的貼附，來使處理效率提升。

⑶證據1、2與證據3所揭露技術內容及所欲解決之技術問題，並未教示證據1、2與證據3應採取相反之技術手段；又證據1、2與證據3技術內容亦未明確排除或教示元件間之組合於技術本質上不相容，是以原告所述證據3構成對證據1、2否定與排斥的反向教示，無動機結合證據云云，顯不足採。

2.原告主張證據3與證據1或證據3與證據2所欲解決問題不同，且於功能或作用無共通性。證據1、2為貼膜與裁切同一設備，證據3為獨立裁切膜料，未包含貼膜製程，故證據3並未有「貼附工作區」，解決技術問題不同且於功能或作用無共通性，不具結合動機。又證據1至3皆未揭示技術特徵1D、1E，證據3僅為切割及拉撐乾膜，未有貼膜製程，證據3未揭示技術特徵1D，原處分顯有漏未審酌或誤審之虞云云（卷一第22至24頁）。經查：

⑴判斷所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素（最高行政法院113年度上字第456號行政判決意旨參照）。

⑵原處分記載「證據1至3同屬晶圓貼膜技術領域，三者於膜輸送、膜裁切之作用、功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據1、3或2、3後再將證據3切割區之乾膜平整裝置設置於證據1、2貼膜區與切割(裁切)區，而得到系爭專利請求項1之發明，且未具無法預期之功效」(卷一第172頁)，已敘明證據1至3間之組合動機；原

告亦主張證據1、2為同時具有貼膜及裁切之設備，證據3為單獨裁切設備，未包含貼膜作業區未能進行貼膜製程，是以原告肯認證據1、2、3皆應用於晶圓膜料技術領域，具有技術領域關聯性；又證據1、2、3捲狀膜料拉膜、捲收回收廢料之作用或功能具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機結合證據1、2、3，原告所稱證據1、2、3解決問題不同、功能或作用無共通性不具結合動機云云，顯不足採。

⑶依原處分所載，證據3已揭示系爭專利請求項1技術特徵1D、1E除「一拉膜裝置，設置於該貼膜工作區」外其他技術特徵；又證據1、2與證據3間具有組合動機，所屬技術領域中具有通常知識者將面對證據1、2貼附膜料皺褶、捲曲良率問題，具合理動機將證據3晶圓壓模機乾膜輸送機構之乾膜平整裝置技術特徵結合應用至證據1、2之貼膜工作區，是以證據1、3或證據2、3之組合已揭露系爭專利請求項1技術特徵1D及1E，原告所稱原處分顯有漏未審酌或誤審云云，顯不足採。

3.原告主張系爭專利獨立項5中的技術特徵5A及5C，實質對應系爭專利請求項1技術特徵1D及1E，如前述起訴狀第9至10頁所載證據3未揭示系爭專利請求項1技術特徵1D及1E之敘述，證據3亦未揭露系爭專利請求項5技術特徵5A及5C技術特徵，原處分顯有違法不當之虞云云（卷一第27至28頁）。經查：

⑴系爭專利請求項5界定內容未包含「貼膜工作區」之技術特徵，原告稱系爭專利請求項1技術特徵1D及1E與系爭專利請求項5技術特徵5A及5C技術內容實質相同云云，顯係誤解系爭專利請求項5所記載技術內容。

⑵依原處分第10頁所載，經比對證據3已揭示系爭專利請求項5所有技術特徵（卷一第174頁）；如前述理由㈢之1.所載，證據3與系爭專利請求權項5經比對差異僅在文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，原告所稱原處分有違法不當云云，顯不足採。

4.原告主張證據1、2及證據3皆未揭露系爭專利請求項8中的技術特徵8D「執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜」。原處分認為技術特徵8D被揭露之意見明顯有漏未審酌或誤審之問題云云（卷一第29頁）。經查：原處分就證據3圖式第5圖及說明書第7頁揭示內容已對應系爭專利請求項8技術特徵8D為比對，記載「證據3第5圖揭露乾膜平整裝置3於第一端及下一個貼附區之間拉動乾膜，證據3說明書第7頁最後1段揭露『當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度。』因此，證據3已揭露系爭專利請求項8『以及執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜』之技術特徵」(卷一第178頁)，原告主張被告顯有漏未審酌或誤審云云，顯不足採。

5.原告主張系爭專利請求項1技術特徵1E及技術特徵5C明確記載夾持機構可沿夾持方向相對拉膜機構移動以夾持薄膜，依據系爭專利說明書第[0027]、[0028]段及圖5、7揭示該夾持機構需沿夾持方向夾持薄膜，證據3之夾具未能直接證明該夾具沿夾持方向(上下)移動之技術特徵，參加人之推論已逾證據3之技術內容，且證據3之夾具未能沿夾持方向移動屬固定式夾具，與系爭專利兩夾持件至少一者會相對移動夾持或釋放之概念有別。另系爭專利請求項1技術特徵1E不會對薄膜產生應力，可直接進行貼膜作業，證據3之夾具會對乾膜產生應力，不利於進行貼附；證據3亦未揭示拉膜裝置具有一貼膜工作區之技術特徵，是證據1、3或證據2、3之組合未能輕易完成系爭專利請求項1之發明，證據3未能證明系爭專利請求項5不具新穎性云云（卷一第499至508頁）。惟查：

⑴系爭專利請求項1技術特徵1D、1E及請求項5技術特徵5C記載如技術特徵附表所示。

⑵技術特徵1D部分：證據3為一種晶圓壓膜機乾膜輸送機構，雖未揭示系爭專利請求項1之「貼膜工作區」技術特徵，然證據1或證據2已揭示具有「貼膜工作區」技術特徵，而爭點係證據1、3或證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自應以證據1、3或證據2、3之組合為比對，且如原處分所載證據1、2、3具技術領域共通性，作用、功能上具有關聯性，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據1、3或2、3，而得到系爭專利請求項1技術特徵1D「貼膜工作區」之特徵，原告所述理由顯不足採。

⑶技術特徵1E及技術特徵5C部分：

①系爭專利說明書第[0017]段記載「一個拉膜機構420可沿一拉膜方向D21相對基座410移動，並且另一個拉膜機構420可沿相反於拉膜方向D21的拉膜方向D22相對基座410移動」；第[0018]段記載「兩個夾持機構430的夾爪可沿夾持方向D3相對拉膜機構420移動，以使夾持機構430夾持薄膜」，是該拉膜裝置之夾持機構430相對拉膜機構420做上下夾持、釋放動作。

②證據3說明書第7頁第3段記載「該乾膜平整裝置3係得以對乾膜進行夾持，以利出料裝置21進行捲動換料時得以同步隨乾膜做位移以保持乾膜平整度，該乾膜平整裝置3係為一兩端與導軌13活動設置並呈現跨置於乾膜上方之機動桿體31，另該機動桿體31於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之夾具311」，及圖式第2、3、5圖揭示該夾具311夾持乾膜兩端向外拉撐(相當系爭專利夾持方向)之平坦態樣後，沿導軌13方向(相當系爭專利薄膜的輸送方向)進行輸送之技術內容。

③證據3未定義該夾具311區分為拉膜機構與夾持機構，惟由前揭證據3說明書及圖式揭露內容，證據3之乾膜藉由夾具311「夾持」、「向外拉撐」之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者可由證據3所揭示內容直接且無歧異得知該夾具311為進行乾膜之拉撐獲得平坦態樣，該「夾持」動作即包含

上、下方向之夾持動作，與該拉膜方向呈實質正交，是以證據3已揭示系爭專利請求項1技術特徵1E及請求項5技術特徵5C之內容，原告稱參加人之推論已逾證據3揭示內容之論述云云，顯不足採。

⑷系爭專利或證據3皆未載明夾持機構為固定式或活動式，亦皆未敘及夾持應力對貼膜之影響性，原告稱系爭專利活動式夾持方式與證據3固定式夾持方式有別，夾持應力影響不利薄膜貼附之理由，顯乏依據而不足採。

6.原告主張系爭專利請求項8技術特徵8D「以及執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜」之內容，系爭專利技術特徵8D明確記載該拉膜程序，證據3未有貼膜工作區自未有鏤空洞之技術特徵；且證據3之夾具隨乾膜同步移動方式對乾膜產生內應力或外力造成翹曲、皺摺及尺寸變形，在未有晶圓支撐下不利於馬上進行乾膜貼附，證據1、2裁切時將薄膜貼附於晶圓，晶圓提供支撐，證據3受應力拉撐之乾膜平整裝置，設置證據1、2之貼膜工作區，影響乾膜之貼附精度，所屬技術領域中具通常知識者沒有動機將證據3的夾具轉用至證據1、2之的貼附區，所屬領域具通常知識者不會在證據1或證據2的貼膜工作區設置此裝置，被告稱所屬領域具通常知識者能基於證據1、3或證據2、3所能輕易完成，僅為單純位置變更等論述顯為後見之明云云（卷一第508至510頁）。經查：

⑴系爭專利請求項8之請求標的為「一種晶圓貼膜方法」，該貼膜方法主要包含貼膜程序、裁切程序及拉膜程序，原告爭執證據3未揭露系爭專利技術特徵8D之「以及執行一拉膜程序，於該鏤空洞的該第一端以及該下一個貼附區之間拉動該薄膜」，然查證據3說明書第7頁第2段至第8頁第1行及圖式第5圖揭示「該出料滾筒21係做為捲捆未經切割之乾膜，該收料滾筒22係做為捲收經切割後之乾膜餘料。……當延展於作業平台11之乾膜完成切割作業後，該機動桿體31即移動至作業平台11一端並透過夾具311對乾膜進行夾持、拉撐，當

出料裝置2進行捲動換料時再同步隨乾膜做位移至作業平台11另一端，藉以使乾膜未經切割區段得於作業平台11上呈現較佳之平整度」之內容，證據3圖式第5圖已揭示該乾膜經切割後具有鏤空洞之特徵，是證據3已揭示系爭專利技術特徵8D之技術內容。

⑵原告稱證據3夾具隨乾膜同步移動方式，因應力或外力造成乾膜邊緣翹曲、皺褶或尺寸變形等變異，無法直接進行乾膜貼附作業，惟降低膜料邊緣翹曲、皺褶或尺寸變形等變異，以利進行貼膜動作為所屬技術領域之通常知識，證據3之夾具亦藉由機動桿體於兩端係各設有一可對乾膜兩側進行夾持，並可向外拉撐使乾膜獲得平坦態樣之目的一致；原告所稱證據3之夾具易因應力或外力作用造成乾膜邊緣翹曲、皺褶及尺寸變形等變異等均乏依據，顯不足採。

⑶證據1、證據2及證據3同屬晶圓貼膜技術領域，三者於膜料輸送、貼膜於作用、功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據1、證據3或證據2、證據3或證據1、證據2、證據3，將證據3拉膜程序設置於證據1、2貼膜區與切割(裁切)區，而得到系爭專利請求項8之發明，且未具無法預期之功效。是以系爭專利請求項8係為所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、證據3或證據2、證據3或證據1、證據2、證據3之組合所能輕易完成，不具進步性。

柒、綜上所述，系爭專利請求項1至4、8至12違反核准時專利法第22條第2項規定；請求項5至7違反核准時專利法第22條第1項第1款規定，原處分所為「請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必要。

玖、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　吳俊龍

法　官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格

	或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　12　　日

書記官　吳祉瑩